

Plasma Germany Fachausschuss Normung

Frühjahrssitzung 2017, Hannover Berichtszeitraum Herbst 2016 – Frühjahr 2017

*Uwe Beck
Fachbereichsleiter 6.7
„Oberflächenmodifizierung & -messtechnik“*

DIN NA 062-08-16

Chemische Oberflächenanalyse und Rastersondenmikroskopie

Obmann/stellv. Obfrau

W. Unger (BAM, Tel. 030 8104 1843), B. Hagenhoff (TASCON)

Sitzungen im Berichtszeitraum

Berlin, Februar 2017

Nächste Sitzung

Berlin, Juni 2017

Bemerkungen

DIN NA 062-08-16 AA ist Spiegelausschuss zu
ISO TC 201 „Surface Chemical Analysis“ (www.iso.org)

DIN NA 062-08-16

Chemische Oberflächenanalyse und Rastersondenmikroskopie

Aktuelle Normen/Projekte

Nummern der Norm: ISO 18115-1, ISO 18115-2, DIN ISO 18115-1

Namen der Norm: Vocabulary -- Part 1: General terms and terms used in spectroscopy

Vocabulary -- Part 2: Terms used in scanning-probe microscopy

Status der Norm: permanente Revision

TC 201 SC1 Terminology

Es wurde die Ergänzung der [Terminologie-Normen ISO 18115-1](#) und [18115-2](#) abgeschlossen und weitere permanente Revision vereinbart. Geplant ist [ISO 18115-3 „Terms used in optical interface analysis“](#).

Die deutsche Übersetzung der Norm ISO 18115-1, DIN ISO 18115-1, ist über den Beuth-Verlag erhältlich.

DIN NA 062-08-16

Chemische Oberflächenanalyse und Rastersondenmikroskopie

Aktuelle Normenentwicklungen unter deutscher Beteiligung

Nummer der Norm: 20579-4

Name der Norm: Surface Chemical Analysis - Sample handling, preparation and mounting - Part 4 – Reporting information related to the history, preparation, handling and mounting of nano-objects prior to surface analysis

Status der Norm: CD approved with comments

SC2 General procedures

Contributions from BAM, FhG Dresden, BfR

DIN NA 062-08-16

Chemische Oberflächenanalyse und Rastersondenmikroskopie

Aktuelle Normenentwicklungen unter deutscher Federführung

Nummer der Norm: TR 19693

Name der Norm: Surface chemical analysis -- Characterization of substrates for biosensing application

Status der Norm: DTR, Revision ist erfolgt, Ballot vor der nächsten TC Sitzung im September 2017

TC 201 WG 4 Surface Characterization of Biomaterials

CEN TC 352: Nanotechnologies WG1



Measurement, Characterization, Performance Evaluation

Convenor

E. Frejafon, INERIS, Frankreich

BAM-Vertreter

M. Griepentrog, Tel. 030 8104 3555

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

März 2017 (noch keine Rückmeldung)

ISO TC 164 SC3

Hardness Testing

Convenor

M. Griepentrog, BAM

BAM-Vertreter

M. Griepentrog, Tel. 030 8104 3555

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

September 2017

Bemerkungen

Fokus auf Mikro und Nanobereich sowie Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025, z.B. bezüglich „uncertainty budgets“

ISO TC 164 SC3

Hardness Testing

Aktuelle Normen/Projekte

Norm ISO 14577

Bezeichnung Metallic materials -- Instrumented indentation test for hardness and materials parameters – Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatings

Status Publikation Dezember 2016

CEN TC 352 WG1 und ISO TC 164 SC3

Aktuelle Normen/Projekte

Norm New project

Bezeichnung Nanotechnologies:
Nano- and micro-scale scratch testing

Status Draft NWIP

VDI / VDE – GMA 3.41 Oberflächen- messtechnik im Mikro- und Nanobereich

Obmann

L. Könders, PTB

BAM-Vertreter

A. Hertwig, 030 8104 3515

Sitzungen im Berichtszeitraum

zwei

Nächste Sitzung

September 2017

Bemerkungen

Gremium schreibt fort: VDI 2655 (Oberflächencharakterisierung mittels optischer Interferenz- und Konfokalmikroskopen), VDI 2656 (Oberflächencharakterisierung mittels Rastersondenmikroskopen).

VDI / VDE – GMA 3.41 Oberflächen- messtechnik im Mikro- und Nanobereich

Aktuelle Normen/Projekte

Norm	VDI-Richtlinie 2656-Blatt 2
Bezeichnung	Verfahren zur Rauheitsmessung mit Rastersondenmikroskopen
Status	veröffentlicht
Ansprechpartner	L. Koenders, Th. Dziomba, PTB

VDI / VDE – GMA 3.41 Oberflächenmesstechnik im Mikro- und Nanobereich

Aktuelle Normen/Projekte

Norm:	VDI-Richtlinie 2655-Blatt 1.3
Bezeichnung:	Kalibrieren von flächenhaft messenden Interferometern und Interferenzmikroskopen für die Formmessung
Status:	Gründruck in Vorbereitung
Ansprechpartnerin:	Fr. R. Kafka, Trioptics Berlin
Bemerkung:	siehe auch DIN EN ISO 25178, Teile 1 bis 13 GPS: Geometric Product Specification

DIN NA 062-01-64

Kohlenstoffschichten

Obmann/stellv. Obmann

J. Becker, Balzers; J. Gäbler FhG IST

BAM-Vertreter

U. Beck, 030 8104 1821

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

Mai 2017

Bemerkungen

Spiegelausschuss zu ISO TC 107

DIN NA 062-01-64

Kohlenstoffschichten

Aktuelle Normen/Projekte

Norm	DIN 4855
Bezeichnung	Kohlenstoffschichten – DLC Schichten – Beschreibung der Schichtarchitektur
Status	veröffentlicht
Ansprechpartner	J. Becker, Balzers
Aktuelles:	Normungsinitiative Japan, Klassifizierung von Kohlenstoffschichten mittels Ellipsometrie (Treffen JP – DE November 2016 in der BAM), Vereinbarung: Durchführung eines Ringversuchs; Ansprechpartner: U. Beck

DIN_NA_062-01-61 Mess- und Prüfverfahren für metallische/anorganische Überzüge



Obmann/stellv. Obmann

P. Vollmer, Fischer GmbH; U. Beck, BAM

BAM-Vertreter

U. Beck, Tel. 030 8104 1821

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

Juni 2017

Bemerkungen

Spiegelgremium zu ISO TC 107 und CEN TC 262

DIN_NA_062-01-61 Mess- und Prüfverfahren für metallische/anorganische Überzüge

Aktuelle Normen/Projekte

Norm	DIN 50989-1 (Deutsch/Englisch)
Bezeichnung	Ellipsometrie – Grundlagen
Status	veröffentlicht, März 2017
Ansprechpartner	U. Beck, BAM
Bemerkungen	Vortrag Beck ISO TC 107, Tokyo, Januar 2017; JNWIP (JP, DE) in 2017; Fortführung der Arbeiten in DE im Ausschuss Mess- und Prüfverfahren (und nicht im Ausschuss Kohlenstoffschichten)

DIN_NA_027-01-03

Dünne Schichten für die Optik

Obmann/stellv. Obmann

H.J. Niederwald (ZEISS, ausgeschieden), J. Terhüne (BTE)

BAM-Vertreter

U. Beck, Tel. 030 8104 1821

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

Mai 2017

Bemerkungen

Spiegelgremium zu ISO TC 172 „Optics and Photonics“

DIN_NA_027-01-03

Dünne Schichten für die Optik

Aktuelle Normen/Projekte

Norm	DIN 58131 (deutsch/englisch)
Bezeichnung	Optische Volumenfilter
Status	veröffentlicht November 2016
Ansprechpartner:	H.J. Niederwald, D. Ristau
Bemerkungen:	Modellmäßige Beschreibung zum Ringversuch „Bewertung der Haftfestigkeit dünner Schichten mittels CAT-Technologie“ auf Glas- und Polymer-Substraten; Akkreditierung CAT-Technologie in der BAM nach DIN EN ISO/IEC 17025 (Antrag März 2017)

CEN TC 262 WG 13

Coating Qualification Tests

Convenor

U. Beck, BAM

BAM-Vertreter

U. Beck, Tel. 030 8104 1821

Sitzungen im Berichtszeitraum

eine

Nächste Sitzung

April 2017

Bemerkungen

diverse Schichtprüfverfahren

CEN TC 262 WG 13

Coating Qualification Tests

Aktuelle Normen/Projekte

Norm: EN 13144

Bezeichnung: Verfahren zur quantitativen Messung der Haftfestigkeit durch den Zugversuch

Status: prEN 13144, Einbeziehung der Stirnabzugsprüfung mittels CAT-Technologie („centrifugal adhesion testing“), Ballott läuft derzeit

Ansprechpartner: U. Beck, BAM

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



uwe.beck@bam.de